

СОДЕРЖАНИЕ

Электронные средства: исследования, разработки	
Волоконно-оптические демультиплексоры с повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Дементьев С. Г., Ключник Н. Т., Кузнецов В. А., Яковлев М. Я.	3
Автоматизированная диагностика химических источников тока. Дзэнзерский В. А., Беда М. А., Житник Н. Е., Лесничий В. Н., Плаксин С. В., Ткаченко Ю. А.	6
Сенсоэлектроника	
Радиационная стойкость нитевидных кристаллов SiGe, используемых для сенсоров физических величин. Дружинин А. А., Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Литовченко П. Г., Павловская Н. Т., Павловский Ю. В., Цмоць В. М., Поварчук В. Ю.	10
Увеличение чувствительности сенсоров изменения показателя преломления среды на основе поверхностного плазмонного резонанса. Ушенин Ю. В., Самойлов А. В., Христосенко Р. В.	12
Температурная зависимость рабочих характеристик пьезоэлектрических сенсоров на основе поливинилиденфторида. Ревенюк Т. А., Федосов С. Н.	15
Автотрассовый газоанализатор. Девятко Г. А., Кучменко В. А., Лацис С. А., Орлов М. А., Партышев В. А., Подольский В. Я.	17
Функциональная микро- и наноэлектроника	
Роль пластической деформации в получении нанокремния. Смыттына В. А., Кулинич О. А., Яцунский И. Р., Марчук И. А.	22
Некоторые особенности ограничителя тока на полсвом транзисторе. Каримов А. В., Джурев Д. Р., Едгорова Д. М., Рахматов А. З., Абдулхаев О. А., Каманов Б. М., Тураев А. А.	25
Обеспечение тепловых режимов	
Моделирование температурных режимов в элементах микроэлектронных устройств. Гаврыш В. И., Косач А. И.	27
Проектирование радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами. Шило Г. Н., Огренич Е. В., Гапоненко Н. П.	30
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок. Гершуни А. Н., Ницки А. П.	34
Режим работы двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства, обеспечивающий минимальную интенсивность отказов. Сочеслав Д. П.	39
Технологические процессы и оборудование	
Высокочастотный реактор с асимметричными электродами для плазмохимического травления полупроводников. Дудин С. В., Лисовский В. А., Давидов А. Н., Плетнёв В. М.	42
Оборудование для формирования омических контактов полупроводниковых приборов на основе соединений A_3B_5 . Александров С. Б., Крупальник К. М., Коршилов Н. А., Кондратьева Т. А.	49
Материалы электроники	
3D-нанокмпозиты — опаловые матрицы с включениями металлического Co и слоистые структуры «опаловая матрица — Co/Ig». Самойлович М. И., Ринкевич А. Б., Белянин А. Ф., Пащенко П. В.	53
Эффективные сцинтилляционные материалы на основе твердых растворов $ZnS_{1-x}Te_x$ и перспективы их применения. Катрунов К. А., Лалаянц А. И., Гальчинецкий Л. П., Старжинский Н. Г., Жуков А. В., Галкин С. Н., Брылёва Е., Зеня И. М., Трубаева О. Г.	60
К истории науки и техники	
Развитие полупроводниковых СВЧ-технологий в НИИ «Орион». Болотовец Н. С., Мальцев С. Б.	65
Аннотации к статьям номера	69
Указатель статей, опубликованных в журнале в 2010	73